

【公報種別】特許法第17条の2の規定による補正の掲載

【部門区分】第7部門第1区分

【発行日】平成28年7月28日(2016.7.28)

【公開番号】特開2014-239012(P2014-239012A)

【公開日】平成26年12月18日(2014.12.18)

【年通号数】公開・登録公報2014-070

【出願番号】特願2013-122042(P2013-122042)

【国際特許分類】

H 01 J 37/20 (2006.01)

H 01 J 37/28 (2006.01)

【F I】

H 01 J 37/20 D

H 01 J 37/20 Z

H 01 J 37/28 B

【手続補正書】

【提出日】平成28年6月8日(2016.6.8)

【手続補正1】

【補正対象書類名】特許請求の範囲

【補正対象項目名】全文

【補正方法】変更

【補正の内容】

【特許請求の範囲】

【請求項1】

荷電粒子又は電磁波の何れかをビームとして発生させるビーム発生手段と、
ワーキングチャンバ内において可動ステージ上に保持された検査対象に、前記ビームを導き照射する1次光学系と、

前記検査対象から発生した二次荷電粒子を検出する2次光学系と、
検出された前記二次荷電粒子に基づいて画像を形成する画像処理系と、
前記可動ステージを駆動させるリニアモータと、
前記可動ステージを駆動させるとときに前記リニアモータから発生する磁場を相殺するための磁場を発生させるヘルムホルツコイルと、

前記リニアモータを駆動させる駆動電流を検出する電流検出手段と、
前記電流検出手段により検出された駆動電流に応じて、前記ヘルムホルツコイルから発生させる磁場の強度を制御する磁場制御手段と、
を備えることを特徴とする検査装置。

【請求項2】

前記可動ステージの位置を検出する位置検出手段を備え、
前記磁場制御手段は、前記電流検出手段により検出された駆動電流と前記位置検出手段により検出された位置に応じて、前記ヘルムホルツコイルから発生させる磁場の強度を制御する、請求項1に記載の検査装置。